

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 1 部門第 2 区分
 【発行日】平成30年9月13日 (2018.9.13)

【公表番号】特表2017-500918(P2017-500918A)
 【公表日】平成29年1月12日 (2017.1.12)
 【年通号数】公開・登録公報2017-002
 【出願番号】特願2016-533718(P2016-533718)
 【国際特許分類】

A 6 1 M 16/00 (2006.01)

A 6 1 L 2/10 (2006.01)

【F I】

A 6 1 M 16/00 3 0 5 A

A 6 1 L 2/10

【手続補正書】
 【提出日】平成30年8月1日 (2018.8.1)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

患者に呼吸ガス流を送出するためのガス送出システムにおいて、前記ガス送出システムは、

前記呼吸ガス流を発生させるために構成されるプロアー組立体であり、前記プロアー組立体は、吸気マニフォールド、前記呼吸ガス流の圧力及び / 又は流量を調整するために構成されるインペラ組立体、並びに患者回路に結合されるように構成される排気マニフォールドを含むガス流路を含んでいるプロアー組立体、並びに

消毒する光を発生させ、前記吸気マニフォールド、前記インペラ組立体及び前記排気マニフォールドの少なくとも 1 つにおける 1 つ以上の内部表面を消毒するために、前記 1 つ以上の内部表面に前記消毒する光を送出するように構成される光システムを有し、

前記消毒する光は、紫外線光である、及び前記光システムは、紫外線光システムである

、
前記消毒する光は、UV_c紫外線光である、及び前記光システムは、前記UV_c紫外線光を発生させるために構成される紫外線光システムである、

前記光システムは、回路基板と、前記回路基板に置かれる多数のUV_cLEDと、多数の細長い光導体とを含む、前記光導体の各々は、前記UV_cLEDの対応する 1 つに結合される、並びに前記UV_cLEDは、前記UV_c紫外線光を発生させ、前記吸気マニフォールド、前記組インペラ立体及び前記排気マニフォールドの少なくとも 1 つに前記UV_c紫外線光を送出するために、前記UV_c紫外線光が前記光導体を通るように構成される、ガス送出システム。

【請求項 2】

患者に呼吸ガス流を送出するためのガス送出システムにおいて、前記ガス送出システムは、

前記呼吸ガス流を発生させるために構成されるプロアー組立体であり、前記プロアー組立体は、吸気マニフォールド、前記呼吸ガス流の圧力及び / 又は流量を調整するために構成されるインペラ組立体、並びに患者回路に結合されるように構成される排気マニフォー

ルドを含むガス流路を含んでいるフロアー組立体、並びに

消毒する光を発生させ、前記吸気マニフォールド、前記インペラ組立体及び前記排気マニフォールドの少なくとも1つにおける1つ以上の内部表面を消毒するために、前記1つ以上の内部表面に前記消毒する光を送出するように構成される光システムを有し、

前記消毒する光は、紫外線光である、及び前記光システムは、紫外線光システムである、

前記消毒する光は、UV、紫外線光である、及び前記光システムは、前記UV、紫外線光を発生させるために構成される紫外線光システムである、

前記光システムは、回路基板と、前記回路基板に置かれる多数のUV、LEDとを含む、並びに

前記吸気マニフォールド、前記インペラ組立体及び前記排気マニフォールドの少なくとも1つは、前記UV、紫外線光に対し透過である材料から作られる、ガス送出システム。

【請求項3】

患者に呼吸ガス流を送出するためのガス送出システムにおいて、前記ガス送出システムは、

前記呼吸ガス流を発生させるために構成されるフロアー組立体であり、前記フロアー組立体は、吸気マニフォールド、前記呼吸ガス流の圧力及び/又は流量を調整するために構成されるインペラ組立体、並びに患者回路に結合されるように構成される排気マニフォールドを含むガス流路を含んでいるフロアー組立体、並びに

消毒する光を発生させ、前記吸気マニフォールド、前記インペラ組立体及び前記排気マニフォールドの少なくとも1つにおける1つ以上の内部表面を消毒するために、前記1つ以上の内部表面に前記消毒する光を送出するように構成される光システムを有し、

前記消毒する光は、紫外線光である、及び前記光システムは、紫外線光システムである、

前記消毒する光は、UV、紫外線光である、及び前記光システムは、前記UV、紫外線光を発生させるために構成される紫外線光システムである、

前記光システムは、回路基板と、前記吸気マニフォールド、前記インペラ組立体及び前記排気マニフォールドの少なくとも1つの一部の内部に埋め込まれる第1の多数のUV、LEDと、前記回路基板に置かれる第2の多数のUV、LEDと、前記フロアー組立体の1つ以上の部分を通り延在している多数の光導体とを含み、並びに

前記光導体の各々は、前記第2の多数のUV、LEDの対応する1つに結合されている、

ガス送出システム。

【請求項4】

前記インペラ組立体は、前記透過である材料から作られる、請求項2に記載のガス送出システム。

【請求項5】

前記吸気マニフォールドは、前記透過である材料から作られる、請求項2に記載のガス送出システム。

【請求項6】

前記排気マニフォールドは、前記透過である材料から作られる、請求項2に記載のガス送出システム。